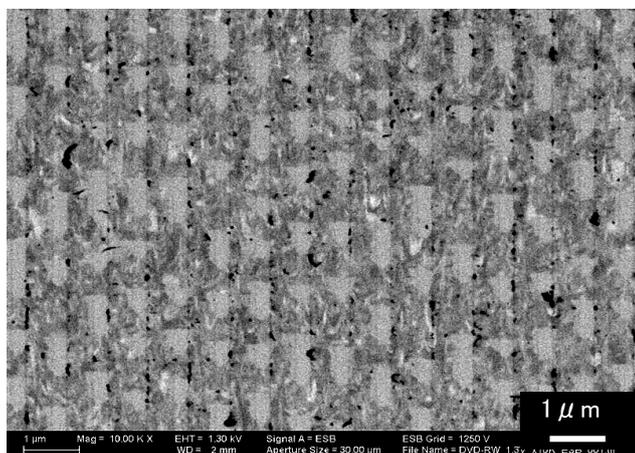




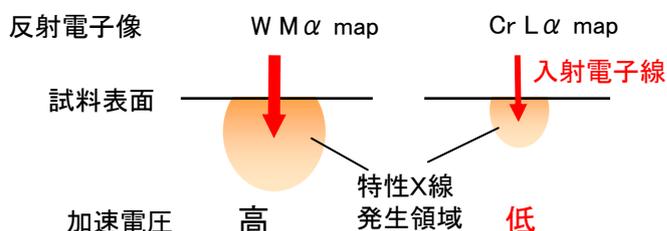
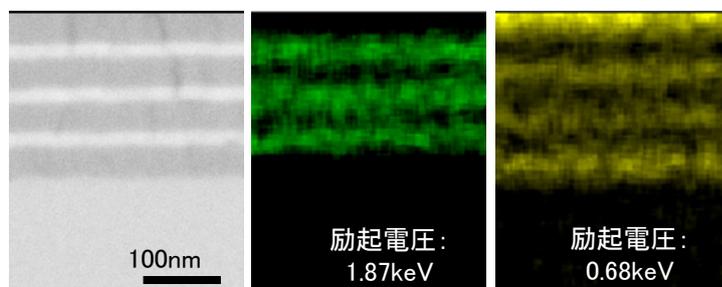
# 新しい表面観察技術

最新のSEM(走査電子顕微鏡)による新しい表面分析の世界をご提供します。

## ULV-SEM(極低加速電圧SEM)による表面観察/ナノエリア分析



DVD記録層の観察例 (加速電圧1.3kV)

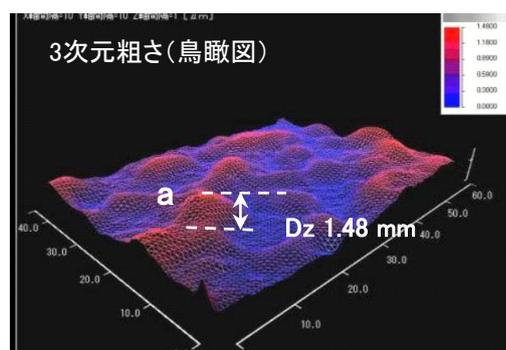
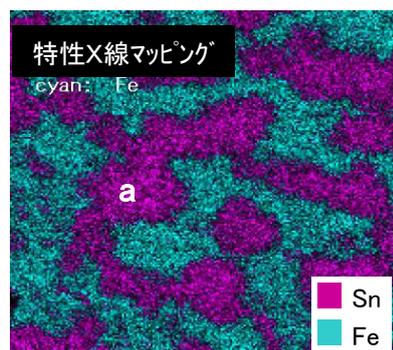
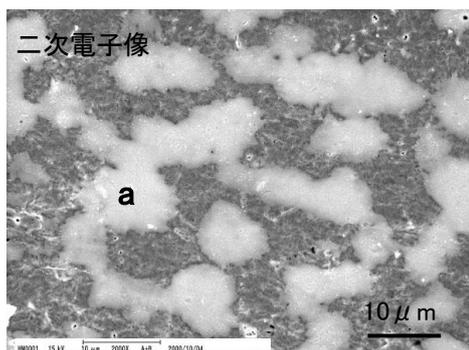


Cr/W多層膜の特性X線マッピングの分析例 (加速電圧 2.7kV)

写真は無蒸着での反射電子像。白色領域はレーザー記録部で、非晶質構造と推定される。加速電圧を下げることで、表面構造を反映したコントラストが見える。

2.7kVの低加速電圧とすることにより、10nmオーダーの特性X線マッピング像が分析可能。Cr(35nm)/W(12nm)の多層膜構造が確認できた。

## トポグラフィ-SEMを用いた材料表面ナノレベルの粗さ測定



Snめっき鋼板のめっき層表面の元素分布と三次元粗さの分析例 (加速電圧 15kV)

同一場所の特性X線マッピングと粗さが分析可能(島状Snのa位置における粗さ: 1.5 μm)



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2010 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved. 本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。